

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

process signal after the removal process is performed thereon on the basis of the reference signal output from the reference signal output unit having a gain value set therefor by the gain setting unit.

(57) 要約: 検査装置1は、参照信号出力部24と、除去処理部25と、ゲイン設定部26と、電気特性測定部28と、を備える。参照信号出力部24は、半導体試料Sと電氣的に並列に外部電源装置2に接続されると共に、外部電源装置2の出力に応じた参照信号を出力する。除去処理部25は、半導体試料Sから出力された電流信号から外部電源装置2の出力によるノイズ成分の除去処理を参照信号に基づいて行い、処理信号を出力する。ゲイン設定部26は、処理信号に基づいて、参照信号出力部のゲインの値を設定する。電気特性測定部28は、ゲイン設定部によってゲインの値が設定された参照信号出力部からの参照信号に基づき除去処理が行われた処理信号に基づいて、半導体試料Sの電気特性を測定する。